

進捗報告: 東京工芸大学の小林信一先生の研究室とLOCOMTEC社 萩原AIPS研究所との産学共同研究開発が開始しました。2026年2月17日に岩崎正昭代表と萩原良昭が小林信一先生を訪問し、このWafer 3枚をお渡し、第1 Step として、まずは、Silicon結晶表面を常温で3 μ mエッチングするKOH液Etchingの条件出しを開始しました。詳細は下記サイト参照。

How to make Multi Junction Solar Cell Yoshiaki Hagiwara.html

実質10日間程度で原理試作のサンプルの作製は可能です。



住友重機械マテリアルソリューションズ(株)さんのご好意を受けて、萩原良昭の自宅に先日の2025年12月17日に、P-type 200mm Silicon Wafer 100 Ω cmが3枚届きました。
<https://shi-ms.com/jp/news/news1699/>
このWaferを3cm x 3cm chipに加工します。

その後は、従来型のSingle接合型の太陽電池の製法プロセスを追加します。それだけで、萩原提案のP+PNPP+ダブル接合型太陽電池がSAMPLE試作できます。

厚木市所在の東京工芸大学の小林信一教授の研究室で2026年2月中旬から原理試作にこの3cm x 3cm chipを使い挑戦する予定です。

ほかの大学でも挑戦をお願い申し上げます!

太陽光エネルギーは人類の財産です♡



Slot 1 イオン打ち込みなし
Slot 2 リンイオン打ち込み
Slot 3 リンとボロンのイオン打ち込み